

국 문 규 격 서

관세분류번호 HSK No.	품목번호 Item No.	품 명 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
9012-90-9000		SEM Tester System	Sys	1

A. 장비 개요 :

1. 본 장비는 주사전자현미경 내부에 장착되어 마이크로구조 레벨 시편의 기계적 특성과 동적 연구에 사용되는 인장 실험 장치이다.
2. 본 장비는 실험 시편의 강도에 따라 다양한 하중의 로드셀(2N, 20N, 200N)을 지원하여야 하고 시편이 20mm이상 인장 될 수 있도록 지원하여야 한다.
3. SEM에 장착될 수 있도록 작고 견고하게 제작 되어야 하며, SEM 밖에서도 사용할 수 있도록 지원되어야 한다.
4. 온도에 따른 시편의 특성을 측정하기 위해 -20℃~160℃의 온도를 지원하여야 하며 Water-cooled Peltier방식으로 온도가 제어되어야 한다.

B. 장비 구성 :

- | | |
|--|-------|
| 1. SEM Tester System | 1 sys |
| 2. 30mm to 50mm between clamps | 1 set |
| 3. Peltier cooled and heated platform | 1 set |
| 4. 온도 컨트롤러 | 1 ea |
| 5. Water-cooling connections and chiller | 1 set |

C. 장비 사양 :

1. 최대하중 : 20N
2. Load cell Accuracy : $\pm 1\%$ of full-scale
3. Resolution : 0.1% of full-scale
4. Speed range : 0.1 mm/min to 1.5 mm/min
5. Max sample size : 50 x 15 x 10 (L, B, H mm)
5. 시스템 크기 : 132 x 67 x 41 (L, B, H mm)
2. 시스템 무게 : ~1 kg
3. 온도 게이지 범위 : -20℃ ~ 160℃
2. Extension 범위 : 20 mm
7. 메인 전원 : 100~120V/60Hz

D.. 기타사항

1. 보증기간 : 장비 설치 후 1년.
2. 설치 및 교육 실시 : 1일 간 설치 및 운영교육 무상 지원.